

## 「半導体工場の廃水資源リサイクルに向けた新規イオン分離プロセスの開発」

宮下 匠人 工学研究院材料科学部門・環境材料学研究室

email: miyashita.takuto@eng.hokudai.ac.jp

研究室HP <https://lmse.eng.hokudai.ac.jp/>

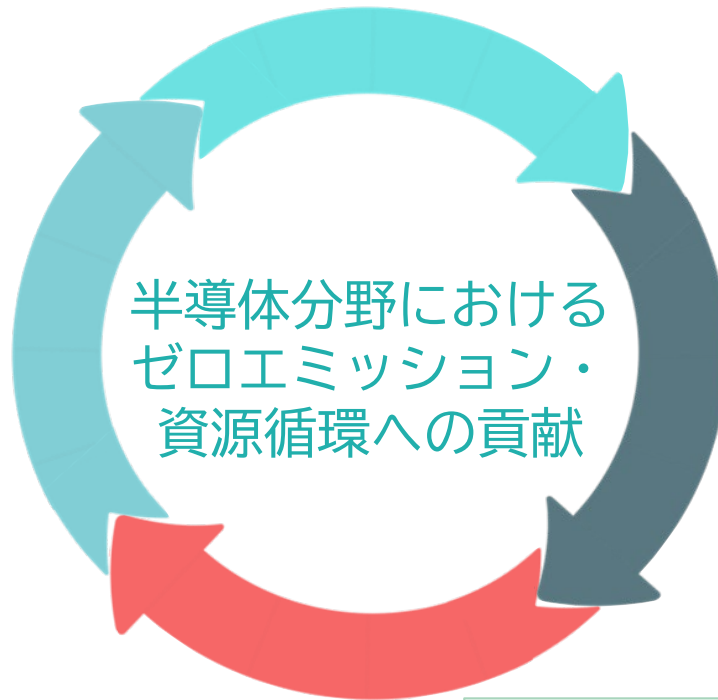
関連キーワード「半導体／リサイクル／フッ素／資源」

### 研究の目的

- ✓ 半導体製造工程で発生する廃水から重要資源を回収
- ✓ エッチング等で生じるフッ素含有廃水等を対象

### 研究内容

- ✓ 対象組成の廃水から有価資源を高効率に分離するプロセスを開発



### 期待される効果・貢献

- ✓ フッ素資源サプライチェーンの革新
- ✓ 廃棄物削減

### 研究成果

- ✓ フッ素の回収可能性を実証
- ✓ 反応メカニズムの解析

